

辉光放电无定形硅氢薄膜光隙 计算的一个简化分析法

朱 维 嘉

(中国科学院上海硅酸盐研究所)

提 要

在计入相干效应和考虑衬底影响的基础上,提出一种非破坏性的简易分析法。利用此法,由非晶硅试样的光谱透射曲线可确定膜层的厚度、折射率及吸收系数。作为例子,我们计算了 α -Si:H 及 α -SiC:H 薄膜的光隙。

一、引 言

辉光放电非晶态硅-氢(GD- α -Si:H)薄膜,是一种极有希望的廉价太阳能电池材料。近年来,它受到人们广泛的重视并得到较深入的研究。随着非晶硅材料科学的进展和电池器件设计的改进,非晶硅太阳能电池的效率获得了稳步的提高^[1]。

光隙,这是非晶硅研究中的一个重要概念。它既是非晶硅(α -Si)材料光学性能的主要表征,也是非晶硅电池设计中的一个关键参量。因此,如何准确地测定 α -Si:H 薄膜的光隙,一直是非晶硅材料领域中受人关注的问题之一。

按照光隙与吸收系数之间的关系^[2]:

$$(\alpha\hbar\omega)^{1/2} = B(\hbar\omega - E_g^*) \quad (1)$$

可知,为了求得 α -Si 薄膜的光隙 E_g^* ,必须测定薄膜的光吸收系数 $\alpha(\omega)$ 。就光隙计算而言,主要感兴趣的吸收范围是 $\alpha > 10^4 \text{ cm}^{-1}$,亦即在吸收边限以上的高吸收 A 区(参见图 1),或称方次律吸收区。

求算 α -Si 薄膜的吸收系数时,常采用接近正入射的透射测量,再根据 Connel 等^[3]导出的公式计算。但这一公式未计入光线透过薄膜时的相干效应,亦未考虑衬底的影响。本文从薄膜光学理论出发,在计及衬底吸收的基础上,推演出试样(包括 α -Si:H 薄膜与玻璃衬底)透射率与薄膜吸收系数之间的关系。以此为基础,同时给出 α -Si 薄膜的厚度、折射率以及玻璃衬底吸收等的具体算式,由此进而算得光隙。这样,只须通过对一块(α -Si:H 薄膜/玻璃)试样光谱透射曲线的解

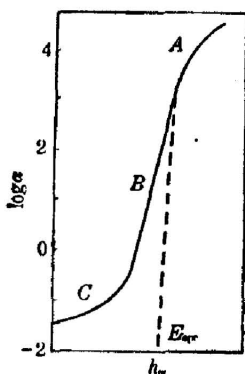


图 1 非晶态半导体中
光吸收谱示意图

Fig. 1 Schematic of the
absorption spectrum of
amorphous semiconductors

析,即可得到 α -Si:H 薄膜材料的光吸收系数与光隙。

二、公式的推演

1. 透射率 T 与吸收系数 α 的关系

薄膜透射率 T 是入射光子能量(或波长)、膜层及衬底光学性质的复杂函数, 解决这个问题基础是 Maxwell 方程。下面, 我们依据薄膜光学的若干结果, 导出薄膜的透射率公式。所有推导均假定光在正入射条件下进行。

试样的光学结构如图 2 所示。图中 n_0 ——入射及出射介质之折射率(一般为空气); \tilde{n}_1 —— α -Si 吸收膜的复折射率, $\tilde{n}_1 = n_1 - ik_1$; n_2 ——透明衬底之折射率; d —— α -Si 薄膜之厚度; D ——透明玻璃衬底之厚度。

由薄膜光学^[4]知, 光通过厚为 d 的 α -Si 膜, 并考虑在膜中的多次反射后, 其透射合振幅为

$$T_1 = \frac{\tilde{t}_1 \cdot \tilde{t}_2 \exp(-i\delta)}{1 + \tilde{r}_1 \cdot \tilde{r}_2 \exp(-2i\delta)} \quad (2)$$

式中 \tilde{r} 、 \tilde{t} 分别为界面的复菲涅尔反射、透射系数; 足标 1 表示空气-薄膜界面, 足标 2 表示薄膜-玻璃界面; 2δ 为透过膜层的相邻二相干光束的相位相差, $2\delta = \frac{4\pi}{\lambda}(n_1 - ik_1)d$, n_1 和 k_1 分别为膜层的实数折射率及消光系数。薄膜透射率则为:

$$T_F = \frac{n_2}{n_0} T_1 \cdot T_1^* = \frac{n_2}{n_0} \cdot \frac{|\tilde{t}_1|^2 \cdot |\tilde{t}_2|^2 \cdot \exp(-\alpha_1 d)}{1 + (\tilde{r}_1^* \tilde{r}_2^* e^{2i\delta} + \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 e^{-2i\delta}) + |\tilde{r}_1|^2 \cdot |\tilde{r}_2|^2 \cdot \exp(-2\alpha_1 d)}, \quad (3)$$

式中“*”号表示复数共轭, $\alpha_1 = \frac{4\pi}{\lambda} k_1$ 为膜层的吸收系数。(3)式右端诸项分别计算如下(参见图 2):

$$\frac{n_2}{n_0} \cdot |\tilde{t}_1|^2 \cdot |\tilde{t}_2|^2 = \frac{16n_0 n_2 (n_1^2 + k_1^2)}{[(n_0 + n_1)^2 + k_1^2] \cdot [(n_1 + n_2)^2 + k_1^2]}, \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \text{以及} \quad \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 \exp(-2i\delta) &= \sqrt{\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2}} \\ &\quad \cdot \exp(-\alpha_1 d) \cdot \exp\left[i\left(\arg \tilde{r}_1 + \arg \tilde{r}_2 - \frac{4\pi}{\lambda} n_1 d\right)\right], \end{aligned}$$

则(3)式右端圆括弧内之和为:

$$\begin{aligned} &2\sqrt{\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2}} \\ &\quad \cdot \exp(-\alpha_1 d) \cdot \cos\left(\frac{4\pi n_1 d}{\lambda} - \arg \tilde{r}_1 - \arg \tilde{r}_2\right). \end{aligned} \quad (5)$$

而

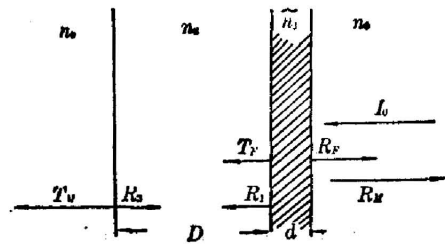


图 2 相应于方程(10)的试样光学结构

Fig. 2 Optical configuration corresponding to Equation (10)

$$|\tilde{r}_1|^2 |\tilde{r}_2|^2 = \left[\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2} \right] \cdot \left[\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2} \right]. \quad (6)$$

将(4)、(5)、(6)三式代入(3)式右端,得到:

$$T_F = \left\{ \frac{16 n_0 n_2 (n_1^2 + k_1^2) \cdot \exp(-\alpha_1 d)}{[(n_0 + n_1)^2 + k_1^2] \cdot [(n_1 + n_2)^2 + k_1^2]} \right\} /$$

$$\left\{ 1 + 2 \cdot \sqrt{\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2}} \right.$$

$$\times \exp(-\alpha_1 d) \cdot \cos \left(\frac{4\pi n_1 d}{\lambda} - \arg \tilde{r}_1 - \arg \tilde{r}_2 \right)$$

$$\left. + \left[\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2} \right] \left[\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2} \right] \cdot \exp(-2\alpha_1 d) \right\}. \quad (7)$$

但由图2可见,实际测得的是整个试样的透射率 T_M ,而不是膜层的透射率 T_F ,因此,必须考虑衬底光学特性的影响。我们按照文献[5]对此类问题的处理方法,令总透射率为

$$T_M = T_S \cdot T_F. \quad (8)$$

引入 T_S 是为了考虑光束在衬底内的附加损失,其值经计算为(参见图2):

$$T_S = (1 - R_3) \exp(-\alpha_2 D) / [1 - R_3 R'_1 \exp(-2\alpha_2 D)]$$

式中 $\alpha_2 = \frac{4\pi}{\lambda} k_2$ 为衬底的吸收系数;因消光系数与折射率相比均很小,所有 k^2 项均可略去,上式简化为:

$$T_S = \frac{\left[1 - \left(\frac{n_2 - n_0}{n_2 + n_0} \right)^2 \right] \cdot \exp(-\alpha_2 D)}{1 - \left(\frac{n_2 - n_0}{n_2 + n_0} \right)^2 \cdot \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2 \cdot \exp(-2\alpha_2 D)}. \quad (9)$$

于是,我们由(8)式得到膜与衬底组合之透射率:

$$T_M = \left\{ T_S \cdot \frac{16 n_0 n_2 (n_1^2 + k_1^2) \exp(-\alpha_1 d)}{[(n_0 + n_1)^2 + k_1^2] [(n_1 + n_2)^2 + k_1^2]} \right\} /$$

$$\left\{ 1 + 2 \sqrt{\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2}} \right.$$

$$\times \exp(-\alpha_1 d) \cdot \cos \left(\frac{4\pi n_1 d}{\lambda} - \arg \tilde{r}_1 - \arg \tilde{r}_2 \right)$$

$$\left. + \left[\frac{(n_0 - n_1)^2 + k_1^2}{(n_0 + n_1)^2 + k_1^2} \right] \left[\frac{(n_1 - n_2)^2 + k_1^2}{(n_1 + n_2)^2 + k_1^2} \right] \cdot \exp(-2\alpha_1 d) \right\}, \quad (10)$$

式中 T_S 由(9)式决定。

2. T_S 之估算

若在(7)式中令 $n_2 = n_0 =$ 空气折射率 $=1$, $n_1 = 1.5$ (玻璃折射率),且不考虑干涉效应(即略去含有余弦的波动项),并注意到所有 k_1^2 相对于前项皆很小,可略去,则可求得衬底玻璃透射率为

$$T_S = \frac{(16 \times 1.5^2 / 2.5^4) \cdot \exp(-\alpha_{\text{玻}} d_{\text{玻}})}{1 + 0.2^2 \cdot \exp(-2\alpha_{\text{玻}} d_{\text{玻}})}. \quad (7a)$$

我们采用的衬底为1mm厚的95料玻璃,实测其可见光平均透射率为90%,代入上式求得

$$\exp(-\alpha_{\text{H}}d_{\text{H}}) = 0.98, \quad (7b)$$

若按通常采用的平板玻璃透射率公式^[6]

$$T = \left[1 - \frac{(n-1)^2}{(n+1)^2} \right]^2 \exp(-\alpha_{\text{H}}d_{\text{H}})$$

计算, 结果是完全一致的。

将(7b)代入(9)式, 并令 $n_1 = 3.5$, $n_2 = 1.5$, $n_0 = 1$, 得

$$T_s = 0.95.$$

为使表达式一般化, 将(10)式中 n_1 写成 n , k_1 写成 k , α_1 写成 α , 并令 $n_0 = 1$ (空气), $n_2 = 1.5$ (玻璃), 再将 $T_s = 0.95$ 代入, 最后即得总透射率为

$$\begin{aligned} T_M = & \left\{ \frac{22.8 \left(n^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right) \cdot \exp(-\alpha d)}{\left[(1+n)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right] \left[(1.5+n)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]} \right\} / \\ & \left\{ 1 + 2 \sqrt{\frac{(n-1)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}}{(n+1)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}}} \cdot \sqrt{\frac{(n-1.5)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}}{(n+1.5)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}}} \cdot \exp(-\alpha d) \right. \\ & \times \cos \left[\frac{4\pi n d}{\lambda} - \text{tg}^{-1} \left(\frac{2\alpha^2 \lambda^2 / 16\pi^2}{1 - n^2 - \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}} \right) - \text{tg}^{-1} \left(\frac{-3\alpha^2 \lambda^2 / 16\pi^2}{n^2 - 2.25 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}} \right) \right] \\ & \left. + \frac{\left[(n-1)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]}{\left[(n+1)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]} \cdot \frac{\left[(n-1.5)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]}{\left[(n+1.5)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]} \cdot \exp(-2\alpha d) \right\}. \quad (11) \end{aligned}$$

这个式子与国外结果^[8,7]略有不同, 见下式:

$$T = \frac{(1-R_1)(1-R_2)(1-R_3)\exp(-\alpha d)}{(1-R_2R_3)\{1 - [R_1R_2 + R_1R_3(1-R_2)^2]\exp(-2\alpha d)\}}. \quad (12)$$

(12)式与(11)式相比, 显然未考虑衬底吸收的影响, 系数显得有差异; 此外, 在式(11)中出现了含有余弦的波动项。可以认为, 该项反映了在近红外低吸收区存在干涉效应。如众所周知, 实测的透射曲线在近红外区确实表现出这种干涉现象, 见图3。因此, (11)式较(12)式更为合理。

计算光隙时, 主要考虑高吸收区, 见图4。这时, 干涉效应可忽略, 即(11)式分母中余弦项不予考虑; 又, 在高吸收区, 一般我们有 $\exp(-2\alpha d) \ll 1^*$, 则(11)式分母中第三项相对于“1”可略去, 故有:

$$T_M = \frac{22.8 \left(n^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right) \cdot \exp(-\alpha d)}{\left[(1+n)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right] \cdot \left[(1.5+n)^2 + \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2} \right]}. \quad (11a)$$

* α 的数值一般不小于 $5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$, d 的数量级为 10^{-4} cm , 则 $\exp(-2\alpha d) = \exp(-10) \ll 1$.

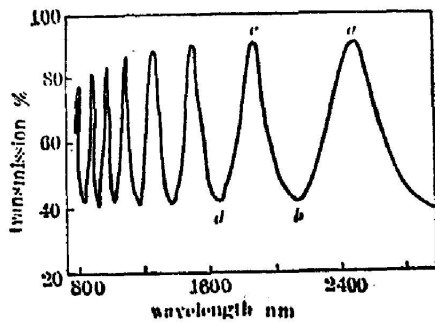


图3 1.1 μm 厚 α-Si:H 膜(玻璃基底)的近红外透射率谱

Fig. 3 Transmittance spectrum (800~3000 nm) of a 1.1 μm thick α-Si:H film on glass substrate

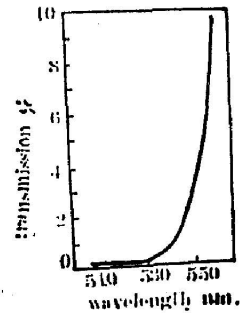


图4 左图中同一试样在波长 510~560 nm 范围内的透射率谱(使用 OD=3 光密度片)
Fig. 4 Transmittance spectrum for the sample in Fig. 3 in the wavelength range 510~560 nm (using a filter with OD=3)

若更注意到 $k^2 = \frac{\alpha^2 \lambda^2}{16\pi^2}$ 与 n^2 等相比很小, 则进一步简化为:

$$T_M = \frac{22.8n^2 \cdot \exp(-\alpha d)}{(1+n)^2(1.5+n)^2} \quad (11b)$$

(11a)与(11b)式, 即我们据之以求 α 的式子。一般采用(11b)式即已足够。

3. 薄膜折射率的计算

在近红外区, α-Si:H 薄膜的折射率实际基本不变, 我们考虑其色散可略; 再者在此区膜层的吸收很小, $\exp(-\alpha d) \rightarrow 1$; 照例可略去 k^2 项, 则(11)式简化为:

$$T = \frac{22.8n^2}{(1+n)^2(1.5+n)^2} \cdot \frac{1}{1 + 2\left(\frac{n-1}{n+1}\right)\left(\frac{n-1.5}{n+1.5}\right) \cos\left(\frac{4\pi n d}{\lambda} - \arg \tilde{r}_1 - \arg \tilde{r}_2\right) + \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2 \left(\frac{n-1.5}{n+1.5}\right)^2}$$

显然 T 具有最大值 T_{\max} 及最小值 T_{\min} , 若用 K 表示两者之比的平方根, 则由上式易得

$$K = \left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}}\right)^{1/2} = \frac{n^2 + 1.5}{2.5n}$$

或

$$n^2 - 2.5Kn + 1.5 = 0 \quad (13)$$

以及

$$(T_{\min})^{1/2} = 2\sqrt{1.5n/(n^2 + 1.5)}$$

或

$$n^2 - \frac{2.45n}{\sqrt{T_{\min}}} + 1.5 = 0 \quad (14)$$

由实测的透射率曲线近红外区量得 T_{\max} 及 T_{\min} , 分别代入(13)或(14)式, 可算得薄膜折射率 n 。例如, 在图3中, 按 A、B 点算得 $n_1 = 3.25$; 按 C、D 点算得 $n_2 = 3.23$, 故折射率可取为 $n = 3.24$ 。这样算得的 n 自然指的是薄膜在近红外区的折射率。由于我们工作的着眼点在于使测量简易可行和分析快速, 因此, 以近红外区的折射率 n 代替可见区的折射率来计算

光隙而不考虑色散。我们对由此引入的误差作个简略分析。由(11b)式易得

$$\Delta\alpha = \frac{2}{d} \left[1 - \frac{n^2 + 2.5n}{(n^2 + 2.5n + 2.5)^2} \right] \frac{\Delta n}{n}$$

计算光隙时, α 的取值应大于 10^4 cm^{-1} , 最好能超过 $5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$, 厚度 d 的数量级为 10^{-4} cm , 因此,

$$\left| \frac{\Delta\alpha}{\alpha} \right| \leq \frac{2}{5 \times 10^4 \times 10^{-4}} \left| \frac{\Delta n}{n} \right| = 0.4 \left| \frac{\Delta n}{n} \right|$$

这样, 折射率的相对偏差为 20% 时, α 的相对误差不超过 8%, 就光隙计算而言, 此误差仍是可容许的。当然, 随着光子能量的增大, 折射率“代用”引起的偏差 $\frac{\Delta n}{n}$ 会增大, 然而幸运的是, 这时 α 也会增大。

4. 薄膜厚度之确定

在由透射率曲线求算 α -Si:H 薄膜厚度时, 存在着一个具体困难, 即: 一般讲, 干涉条纹的级次(即下面式(15)中的 M 值)并不知道。克服此困难的办法是测量两相邻透射极值处的波长, 并应用正入射条件, 得

$$2nd = M\lambda_1 = (M+1)\lambda_2 \quad (15)$$

M 为某一自然数。而有

$$d = \frac{(\lambda_2^{-1} - \lambda_1^{-1})^{-1}}{2n} = \frac{1}{2n\Delta(\lambda^{-1})} \quad (16)$$

结合(13)或(14)式, 即可算得膜厚 d 。例如, 仍见图 3。由 A 、 C 两点算得膜厚为 $1.10 \mu\text{m}$, 由 B 、 D 两点算得为 $1.18 \mu\text{m}$, 故膜厚可取为 $d = 1.14 \mu\text{m}$ 。

至此, 我们已完成了求算 α 的准备工作, 只须依次将由实验曲线所测得的 T_M 和 λ , 以及计算得到的 n 和 d 一并代入(11a)或(11b)式中, 然后解超越代数方程, 便可求得 $\alpha(\lambda)$ 值。

三、测试与结果

光隙测试及计算步骤如下。

首先测量试样的光谱透射率 T_M ; 由所得透射率曲线的红外区(见图 3)按(13)或(14)式可算得薄膜的折射率 n , 由(15)式得出薄膜厚度 d , 然后将它们代入(11a)或(11b), 求出膜层在高吸收区(见图 4)之吸收系数 $\alpha(\lambda)$; 最后, 根据式(1), 作 $\sqrt{\alpha\hbar\omega} \sim \hbar\omega$ 图, 应为一一直线, 外推直线于 $\alpha=0$ 处, 横轴截距即为所求光隙 E_g^* 。作为例子, 我们举出图 5 中 α -SiC:H 试样(▲者)计算光隙时所需的有关数据如下。

光谱透射率是用 Beckmen 仪器公司制造的 UV 5240 及 UV 5270 型紫外-可见-近红外分光光度计测量的。由(11)式的推演过程可知, 测量时须将膜面正对入射光束, 且在参考光阑内不应放置衬底玻璃伴样; 此外, 为使可见光区内短波部分的透射率读数精密起见, 沿该区内波长递减的方向, 依次使用了进口的 $OD=1\sim 3$ 的光密度片。

所研究的样品系采用射频辉光放电法沉积的 α -Si:H 薄膜及 α -SiC:H 薄膜, 衬底为 $\phi 20 \text{ mm}$ 、厚 1 mm 的国产 95 料抛光玻璃片, 衬底加热温度为 300°C 。

表 1 α -SiC:H 试样(图 5)的有关数据

Table 1 Experimental data for the α -SiC:H sample in Fig. 5

波 长 (Å)	透 过 率 (%)	吸收系数 α (cm^{-1})	光子能量 E (eV)	$\sqrt{\alpha E}$ (eV/cm) ^{1/2}
4795	0.0800	6.1×10^4	2.57	396
4770	0.0595	6.4×10^4	2.59	407
4745	0.0440	6.6×10^4	2.60	414
4720	0.0322	6.9×10^4	2.62	425
4695	0.0232	7.2×10^4	2.63	435
4670	0.0165	7.6×10^4	2.64	448
4645	0.0117	7.9×10^4	2.66	458
4620	0.0082	8.2×10^4	2.67	468
4595	0.0055	8.6×10^4	2.69	481
4570	0.0039	8.9×10^4	2.70	490
4545	0.0025	9.3×10^4	2.72	503
4520	0.0017	9.7×10^4	2.73	515
4495	0.0007	1.0×10^5	2.75	524
4445	0.0005	1.1×10^5	2.78	553

该膜层之厚度与折射率业已分别算得为: $d=1.1 \mu\text{m}$, $n=2.8$ (见图 5)。

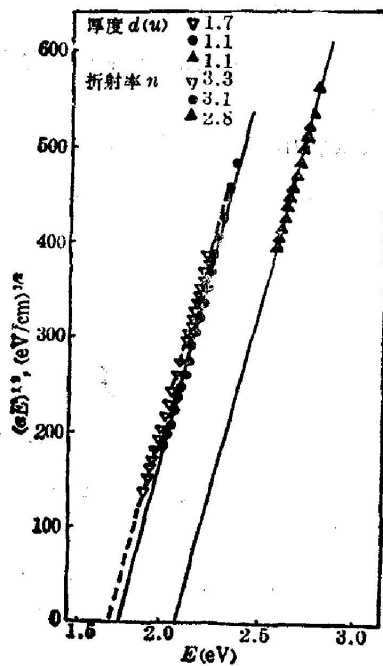


图 5 α -Si:H 膜与 α -SiC:H 膜的 $(\alpha E)^{1/2} \sim E$ 对画图

Fig. 5 Dependence of $(\alpha E)^{1/2}$ on photo energy for α -Si:H and α -SiC:H films

图 5 是有关试样的 $\sqrt{\alpha E} \sim E$ 图。其中“ \blacktriangle ”号为 α -SiC:H 试样,“ \bullet ”号为 α -Si:H 试样,均由本所制备;“ ∇ ”号是 1988 年美国芝加哥大学物理系 H. Fritzsche 教授来我所进行访问研究时所带样品,他们测定的数值是 $E_g^* = 1.71 \text{ eV}$ 。我所按本文前述方法测定光隙,所有主要计算均编成计算机程序,对“ ∇ ”号样品结果为 $D_g^* = 1.73 \text{ eV}$,与国外数据基本吻合。

我们制备的 α -Si:H 及 α -SiC:H 样品,经由上法测定,光隙分别为 1.75 eV 及 2.05 eV 。由图显见,加入碳原子后使膜的光隙变大,成为宽带隙窗口材料。这原因很可能是由于碳的电负性 (2.5) 比氢 (2.1) 及硅 (1.8) 为大,因此,它的加入使得最紧邻原子 i, i' 的配偶轨道 j 之间的相互作用矩阵元^[6]

$$V_2 = \langle i, j | H | i', j \rangle,$$

发生改变,增强了键能,导致了能隙展宽。

参加本工作的还有陈惠明、施雪君。美国芝加哥大学 H. Fritzsche 教授审阅了本文原稿并提出宝贵意见,本所程如光副研究员对

本工作给予关心,作者表示衷心感谢。我所苗华兰、章敏权等同志提供有关样品,沈定坤、陈幼新进行了光谱透射率的测量,在此一并表示谢意。

参 考 文 献

- [1] Yoshihiro Hamakawa; *Solar Energy Mater.*, 1982, **8**, No. 1~3 (Nov), 101.
- [2] E. A. Davis, N. F. Mott; *Phil. Mag.*, 1970, **22**, No. 179 (Nov), 908.
- [3] G. A. N. Connell *et al.*; *Advances in Physics*, 1973, **22**, No. 5 (Sep), 643.
- [4] O. S. Heavens; *Optical Properties of Thin Solids Films*, (Butterworths, London, 1955).
- [5] Hans W. Verleur; *J. O. S. A.*, 1968, **58**, No. 10 (Oct), 1356.
- [6] 西北轻工业学院主编;《玻璃工艺学》, (轻工业出版社, 北京, 1982), 149.
- [7] S. Niita *et al.*; *Solar Energy Mater.*, 1982, **8**, No. 1~3 (Nov), 249.
- [8] Zhu Weijia; *J. Non-Cryst. Solids*, 1984, **65**, No. 1 (Jun), 183.

A simple analytical method for determining the optical gap of amorphous silicon films

ZHU WEIJIA

(Shanghai Institute of Ceramics, Academia Sinica)

(Received 22 March 1985; revised 30 April 1985)

Abstract

For material research and device design of amorphous silicon solar cells, it is required to determine the refractive indices, thickness and absorption coefficients of α -Si films. Taking interferences and substrate effects into account, we propose a simple analytical method that allows us to determine the thickness, refractive index and absorption coefficient of a film from the usual transmittance spectrum at normal incidence. As an example, we calculated the optical gap of α -Si:H and α -SiC:H films.